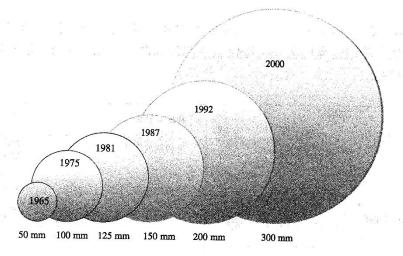
电路集成

大致以集成在一块芯片上的元件数划分集成时代如下:

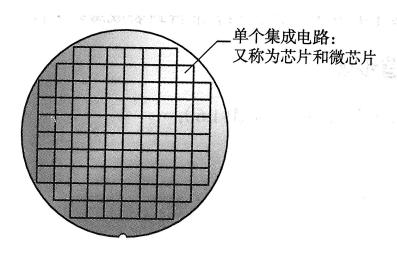
电路集成	半导体产业周期	每个芯片元件数
没有集成(分离元件)	1960年之前	1
小规模集成电路(SSI)	20世纪60年代前期	2-50
中规模集成电路(MSI)	20世纪60年代到70年代前期	20-5000
大规模集成电路(LSI)	20世纪70年代前期到70年代后期	5000-100000
超大规模集成电路(VLSI)	20世纪70年代后期到80年代后期	100000-1000000
甚大规模集成电路 (ULSI)	20世纪90年代后期至今	大于1000000

集成电路制造

芯片也称管芯,硅圆片通常被称为衬底。可以在一片硅片上同时制作几十 甚至上百个特定的芯片,一片硅片上的芯片数的不同取决于产品类型和芯 片尺寸。芯片尺寸的改变取决于在一个芯片集成的水平。硅片的直径一直 在增大。随着硅片上芯片数的增加,制造集成电路的成本会大幅度降低。



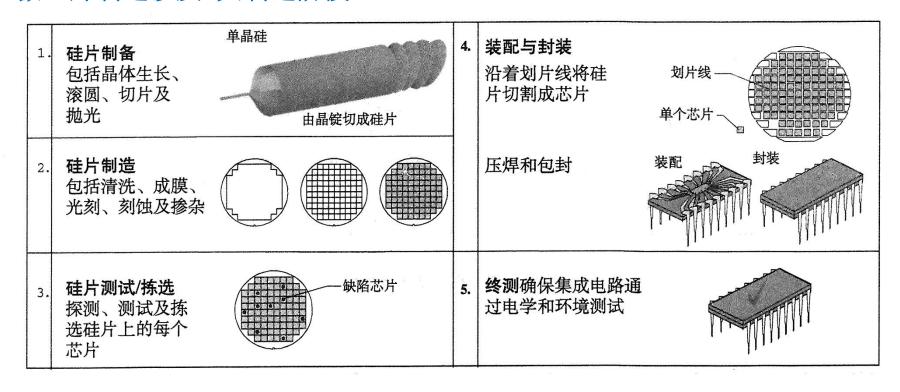
硅片尺寸的演化



含芯片的硅片顶视图

集成电路制造——集成电路的制造步骤

微芯片制造涉及5大制造阶段:



5个阶段相互独立,在半导体公司内具备大型基础设施,并且有提供专业化学材料和设备的工业网支撑。

集成电路制造——发展趋势

用户要求更快、更可靠和成本更低的芯片,受用户需求的驱使,每隔18到24个月,半导体产业就引入新的制造技术。为达到这些要求,芯片制造商减小了芯片上元件的尺寸,从而提高芯片速度、减小功耗。经测试分析,减小尺寸的方法具有长期可靠性。不仅如此,增加一个硅片上的芯片数还可以降低成本。

微芯片技术发展的主要趋势:

- 提高芯片性能
- 提高芯片可靠性
- 降低芯片成本

半导体趋势——提高芯片性能

判断芯片性能的一种通用方法是速度:

- 器件做得越小, 在芯片上放置的越紧密, 速度越快
- 使用材料,通过芯片表面的电路和器件来提高电信号的传输

判断芯片性能的另一种方法是通过芯片上可执行的指令数:

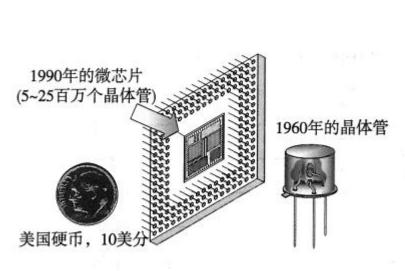
• 每秒百万指令数测算 (MIPS)

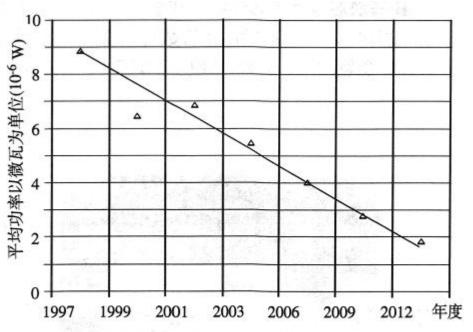
表征芯片性能的参数:

- 关键尺寸——CD
- 每块芯片上的元件数
- 功耗

半导体趋势——提高芯片性能

· 功耗: 相比真空管而言, 半导体器件耗用很小的功率, 随着器件的微型化, 功耗相应减小。尽管每块芯片上的晶体管数迅速增加, 但芯片的功耗却以低得多的速率增长。功耗是便携式电子产品市场增长的一个关键性能参数。



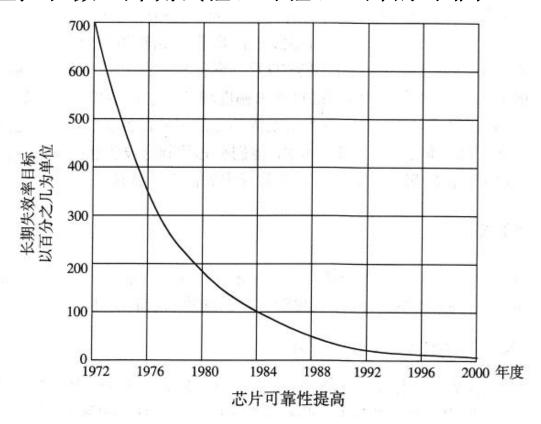


早期和现代半导体尺寸比较

每个集成电路芯片上的功耗降低。由半导体产业协会重画,1997年国家半导体技术蓝图

半导体趋势——提高芯片可靠性

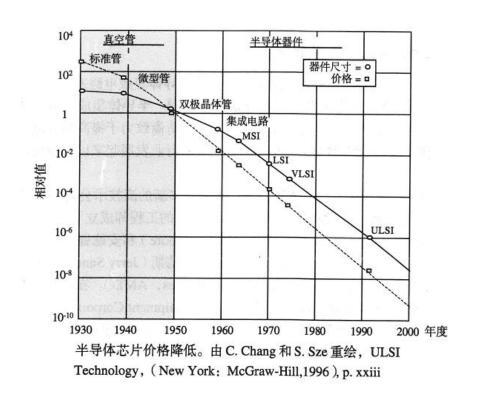
芯片的可靠性致力于趋于芯片寿命的功能的能力,技术上的进步已经提高了芯片的可靠性。通过超净间等技术的使用可控制沾污,进而提高其可靠性,通过硅片监控和微芯片测试验证可验证芯片的可靠性。



半导体趋势——降低芯片价格

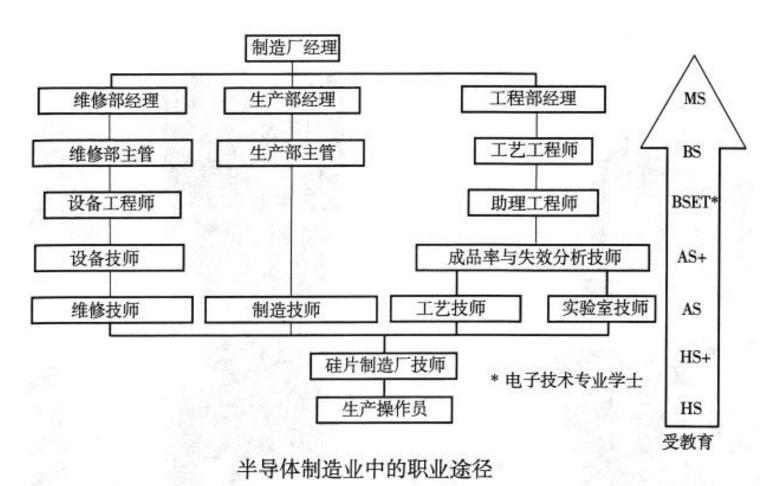
半导体微芯片的价格一直持续下降,近50年终价格下降近一亿倍。

芯片价格降低的根本原因是CD尺寸的减小降低了成本,另一个原因在于半导体产品市场大幅增长引入了制造的规模经济,引入相关加工设备和制造工艺。



制造业中的职业

半导体制造业中的职业主要有三种:技师、工程师和管理人员



1.2 微电子工艺及流程

集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。

微电子工艺:狭义讲是指在半导体硅片上制造出集成电路或分立器件的芯片结构,这20-30各工艺步骤的工作、方法和技术即为芯片制造工艺;广义的讲,包含半导体集成电路和分立器件芯片制造及测试封装的工作、方法和技术。集成电路工艺是微电子学中最基础、最主要的研究领域之一。不同产品芯片的制造工艺就是将多个单项工艺按照需要以一定顺序进行排列,称为该产品的工艺流程。

集成电路制造技术特点

- 超 净:环境、操作者、工艺三方面的超净
- 超 纯:指所用材料,如衬底、功能性电子材料、水、气等
- 高技术: 设备先进,技术先进
- 高精度: 光刻图形的最小线条尺寸在纳米量级

制备的介质薄膜厚度也在纳米量级

而精度更在上述尺度之上

• 大批量, 低成本

集成电路制造

超净室





表 3 中国新 ISO14644-1 标准

超净室分类	浓度极限/(个/m³)						
(级)	≥0.1 μm·	≥0.2μm	≥0.3μm	≥0.5μm	≥1 μm·	≥5µm	
ISO 1	10	2		10 /0			
ISO 2	100	24	10-	4			
ISO 3	1000	237	102	35	8		
ISO 4	10 000	2370	1020	352	83		
ISO 5	100 000	23 700	10 200	3520	832	29	
ISO 6	1 000 000	237 000	102 000	35 200	8320	293	
ISO 7		- 3		352 000	83 2000	2930	
ISO 8				3 520 000	832 000	29 300	
ISO 9	ĺ			35 200 000	8 320 000	293 000	

表 2 美国联邦 209E 标准

超浄室分类(級)	浓度极限/(个/ft³)						
	≥0.1μm	≥0.2μm	≥0.3μm	≥0.5μm	≥5μm		
1	35	7.5	3	1			
10	350	75	30	10			
100		750	300	100			
1000				1000	7		
10000-			0	10000	70		
100000				100000	700		

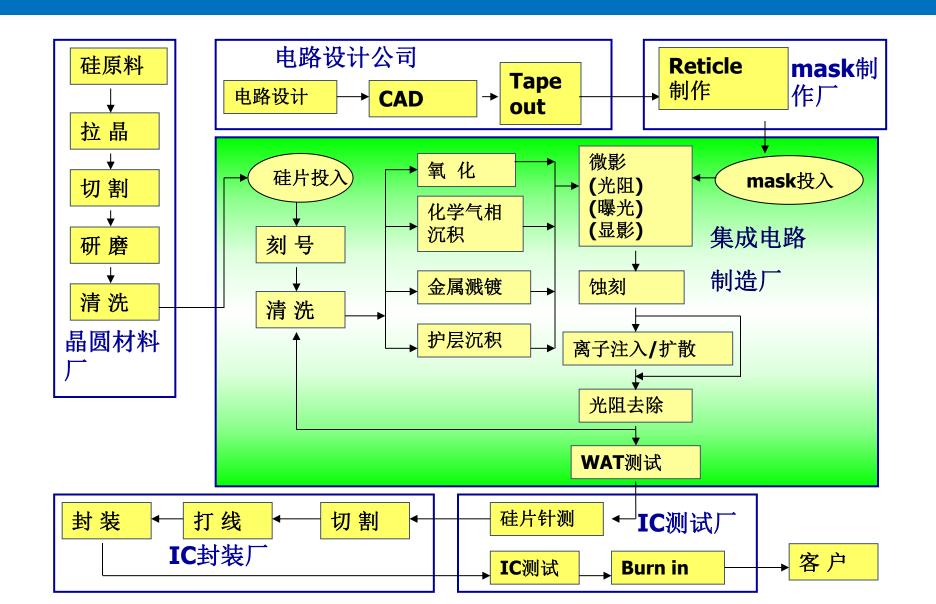
集成电路制造

超纯材料

- 1、超纯的半导体材料, 目前纯度已达到99.999999999%,即11个9,记为11N.
- 2、功能性电子材料(如:AI、Au等金属)、掺杂用气体、 外延气体等必须是高纯度材料。
- 3、所用化学试剂、器皿、器具等的杂质含量必须低。
- 4、芯片清洗用水是高纯度的去离子水,一般用电阻率来表示. 超大规模集成电路纯用水的电阻为18MΩ.cm,

超高精度

集成电路产业流程图



集成电路产业流程图

